

申請日	専利案號	名称
2007年		
2007年3月30日	特3935219	蒸溜酒廃液の真空濃縮乾燥装置
2007年3月16日	特3928989	SiCエピタキシャル薄膜作成方法およびSiCエピタキシャル薄膜作成装置
2007年3月16日	特3928970	積層型透明導電膜の製造方法
2007年3月9日	特3927864	大気圧プラズマ処理装置
2007年3月9日	特3927863	大気圧プラズマ処理装置
2007年2月23日	特3919942	静電吸着装置及び真空処理装置
2007年2月16日	特3917966	真空装置及びその部品に使用されるアルミニウム又はアルミニウム合金の表面処理方法、真空装置及びその部品
2007年2月16日	特3916305	配線薄膜製造方法
2007年2月16日	特3916100	微小部分の膜厚測定方法
2007年2月9日	特3913355	被吸着物の処理方法
2007年2月9日	特3913336	分子線エピタキシャル成長装置、及びダイヤモンド薄膜形成方法
2007年2月2日	特3911206	分析セル、それを用いた質量分析装置、及び質量分析方法
2007年2月2日	特3911191	分析方法
2007年2月2日	特3910243	プラズマ生成用ホローカソード
2007年2月2日	特3909608	真空処理装置
2007年1月26日	特3906973	真空排気装置
2007年1月19日	特3905366	有機EL表示装置
2007年1月19日	特3904342	凍結真空乾燥装置
2007年1月19日	特3903446	ベローズ・ポンプ
2007年1月12日	特3902547	基板処理装置
2007年1月12日	特3901755	磁気記録体
2007年1月12日	特3901754	基板保持装置、スパッタリング装置、基板交換方法、スパッタリング方法
2007年1月5日	特3899146	プラズマ発生装置
2007年1月5日	特3897908	低比誘電性絶縁膜の形成方法、層間絶縁膜及び半導体装置
2007年1月5日	特3897860	密閉品のリークテスト方法
2007年1月5日	特3897853	撥水性窓材の製造方法
2006年		
2006年12月22日	特3894405	真空熱処理装置
2006年12月22日	特3894374	真空処理装置
2006年12月8日	特3888649	プラズマ生成用ホローカソード
2006年12月1日	特3886219	有機EL素子
2006年11月24日	特3884854	反応性イオンエッチング装置
2006年11月24日	特3883910	ワーク処理装置
2006年11月17日	特3880697	マグネトロンプラズマCVD装置
2006年11月10日	特3878846	ディスク型記憶媒体用フィルム基板の巻取り式スパッタリング装置及びこの装置を用いたディスク型記憶媒体用フィルム基板の製造方法
2006年11月2日	特3875920	Cu配線形成方法
2006年11月2日	特3875919	Cu配線形成方法
2006年11月2日	特3875322	真空熱処理炉
2006年11月2日	特3874823	仕込取出室
2006年10月27日	特3872136	真空処理方法
2006年10月27日	特3871957	凍結真空乾燥方法及び凍結真空乾燥装置
2006年10月13日	特3866132	親水性ポリイミド膜の形成方法
2006年10月13日	特3865841	電子ビーム蒸着装置
2006年10月13日	特3865807	有機エレクトロルミネッセンス素子

2006年10月13日	特3865358	有機EL装置の製造方法
2006年10月6日	特3863988	蒸着装置
2006年10月6日	特3863954	成膜対象物の前処理方法
2006年10月6日	特3863934	高分子薄膜の形成方法
2006年9月29日	特3859782	ダイヤモンド冷陰極の気相合成方法及びその製造方法
2006年9月15日	特3853666	熱処理炉
2006年9月15日	特3853487	連続式熱処理炉
2006年9月15日	特3853449	薄膜形成装置
2006年9月15日	特3852967	低圧スパッタリング装置
2006年9月8日	特3850527	静電チャック及びこれを用いた真空処理装置
2006年9月8日	特3850508	プラズマ生成用ホローカソード
2006年9月8日	特3850502	ホローカソードおよびこのホローカソードを具備するイオンプレーティング装置
2006年9月1日	特3847920	静電吸着ホットプレート、真空処理装置、及び真空処理方法
2006年9月1日	特3847871	蒸着装置
2006年9月1日	特3847866	スパッタリング装置
2006年9月1日	特3847863	真空装置及びその製造方法
2006年9月1日	特3847458	小型磁場偏向型質量分析管及びその製造方法
2006年8月25日	特3844608	真空成膜装置
2006年8月11日	特3839758	成膜装置及び成膜方法
2006年8月11日	特3839674	有機蒸着装置及び有機薄膜製造方法
2006年8月11日	特3839673	有機蒸着装置
2006年8月11日	特3839616	表面改質方法、有機薄膜製造方法、及び素子基板
2006年8月11日	特3839587	有機薄膜材料用容器、蒸着装置、有機薄膜の製造方法
2006年8月4日	特3836584	ビームを用いた表面状態測定方法及びダストモニター装置
2006年8月4日	特3836562	イオン照射装置
2006年7月28日	特3833776	広帯域電離真空計
2006年7月28日	特3833275	全方向同時蒸着重合装置
2006年7月28日	特3832934	反応性イオンエッチング装置
2006年7月21日	特3830288	真空装置、及びプラズマディスプレイ装置の製造方法
2006年7月14日	特3827881	真空処理装置及び基板起立装置
2006年6月30日	特3823069	磁気中性線放電プラズマ処理装置
2006年6月30日	特3822481	スパッタリング方法
2006年6月30日	特3821893	スパッタリング装置
2006年6月23日	特3820333	放電プラズマ処理装置
2006年6月16日	特3817123	CVD装置
2006年6月16日	特3817054	蒸着源用るつぼ、及び蒸着装置
2006年6月16日	特3817037	真空蒸着装置、有機EL素子の形成方法
2006年6月16日	特3817036	有機化合物蒸発用容器、有機蒸着源、及び真空蒸着装置
2006年6月2日	特3810452	マグネトロンスパッタ成膜装置
2006年5月26日	特3809391	薄膜形成装置
2006年5月26日	特3808148	複合スパッタリングカソード、そのカソードを用いたスパッタリング装置
2006年5月12日	特3803592	低抵抗透明導電膜及びその製造法
2006年4月21日	特3795518	巻取式真空蒸着装置及び巻取式真空蒸着方法
2006年4月21日	特3794816	真空熱処理方法
2006年4月7日	特3789507	スパッタリング装置
2006年4月7日	特3788835	有機薄膜製造方法
2006年3月24日	特3784522	膜厚モニター
2006年3月17日	特3782255	有機化合物用の蒸着源、及び蒸着装置
2006年3月10日	特3780204	バリアメタル膜又は密着層形成方法及び配線形成方法

2006年3月10日	特3778296	真空装置
2006年3月3日	特3775909	有機薄膜製造方法、及び有機蒸着装置
2006年3月3日	特3775858	成膜装置、成膜方法
2006年3月3日	特3775851	蒸着装置、保護膜製造方法
2006年3月3日	特3775846	移動子、磁気浮上搬送装置、及び搬送軸合わせ方法
2006年2月24日	特3774525	プラズマ中の負イオン測定法及び装置
2006年2月24日	特3774399	デュアルダマシシ構造体及びその形成方法、並びに半導体装置及びその製造方法
2006年2月24日	特3773587	有機化合物モノマーの精製方法
2006年2月10日	特3769341	エッチングプラズマにおける基板入射負イオンの分析法及び装置
2006年2月10日	特3768360	イオン源及びそのイオン源を用いた質量分析計
2006年1月20日	特3761040	真空装置用構造材料および真空装置用構造部材
2005年		
2005年12月16日	特3752358	反応性イオンエッチング装置
2005年12月16日	特3752257	イオンビーム蒸着装置
2005年12月2日	特3746231	ビアボトムの絶縁膜の除去方法及び半導体装置の製造方法
2005年12月2日	特3745051	膜厚測定方法
2005年12月2日	特3744964	成膜装置用構成部品及びその製造方法
2005年11月18日	特3741842	真空蒸着装置、及び薄膜形成方法
2005年11月11日	特3739478	反射防止多層膜とその成膜方法並びにその成膜装置
2005年11月11日	特3739475	磁気浮上搬送装置
2005年11月11日	特3739474	磁気浮上搬送装置
2005年11月4日	特3736938	有機EL素子の製造方法、有機薄膜形成装置
2005年11月4日	特3736928	有機化合物容器、有機蒸発源、及び真空蒸着装置
2005年11月4日	特3736795	エッチング装置
2005年10月28日	特3734913	電離真空計制御装置
2005年10月7日	特3727693	TiN膜製造方法
2005年9月16日	特3720061	薄膜抵抗体の直流スパッタ成膜方法
2005年9月16日	特3719830	金属材料用蒸発源及びこれを用いた真空処理装置
2005年9月16日	特3719797	有機薄膜表面への導電性薄膜形成方法
2005年9月9日	特3718315	イオンビーム照射装置
2005年7月22日	特3701394	ヘリウムリークディテクターによる薄物試験体の漏洩試験方法
2005年7月15日	特3699747	真空蒸着法
2005年7月15日	特3698680	成膜方法
2005年7月15日	特3698506	EL素子、及び有機薄膜表面へのカソード電極膜の形成方法
2005年7月1日	特3693687	蒸溜酒廃液の真空濃縮乾燥槽及び真空濃縮乾燥方法
2005年6月24日	特3691615	有機材料用蒸発源
2005年6月24日	特3690552	金属ペーストの焼成方法
2005年6月3日	特3683538	金属薄帯鑄造装置
2005年5月13日	特3676919	反応性イオンエッチング装置
2005年5月13日	特3675983	ヘリウムリークディテクター
2005年5月13日	特3675958	耐湿性絶縁膜の形成方法及び層間絶縁膜の形成方法
2005年4月15日	特3668535	エッチング装置
2005年4月8日	特3664998	真空処理装置
2005年4月8日	特3664854	真空処理装置
2005年4月1日	特3662293	エッチング電極
2005年3月25日	特3660018	真空装置の異常放電消滅装置
2005年3月25日	特3660016	真空装置の異常放電抑制・消滅装置
2005年3月25日	特3660012	真空装置の直流電源

2005年3月18日	特3657366	漏洩探知方法
2005年3月18日	特3657359	漏洩検知装置
2005年3月11日	特3655966	プラズマ発生装置
2005年2月25日	特3649836	漏洩検知用磁場偏向型質量分析管の分解能向上方法
2005年2月25日	特3649313	カーボン系材料被覆冷陰極の作製方法及び該冷陰極
2005年2月18日	特3646901	プラズマ励起用アンテナ、プラズマ処理装置
2005年1月28日	特3640724	高接触角ポリイミド断熱膜の作製方法
2005年1月28日	特3640386	焦電性高誘電体のエッチング方法及び装置
2005年1月28日	特3640385	焦電性高誘電体のエッチング方法及び装置
2005年1月21日	特3638678	配線孔、及び配線孔製造方法
2005年1月7日	特3634029	真空成膜装置に於ける温度制御方法
2004年		
2004年12月24日	特3630920	金属ペーストの焼成方法
2004年12月17日	特3629305	マグネトロンスパッタカソード
2004年12月17日	特3628395	スパッタカソード
2004年12月17日	特3627838	ダイヤモンド被覆冷陰極の作製方法
2004年12月10日	特3625951	ガス封入電子流型電子管
2004年12月3日	特3623848	有機化合物用蒸発源及びこれを用いた蒸着重合装置
2004年12月3日	特3623292	真空蒸着用基板傾斜自公転装置
2004年11月12日	特3615817	有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法
2004年11月12日	特3615801	窒化チタン薄膜成膜方法
2004年10月29日	特3611940	選択CVD方法、及びCVD装置
2004年10月29日	特3611671	漏洩検知装置用分析管
2004年10月22日	特3609227	蒸着重合装置およびそのクリーニング方法
2004年10月15日	特3606979	枚葉式真空処理装置
2004年10月8日	特3604528	CVD装置クリーニング方法、選択CVD方法、及びCVD装置
2004年10月1日	特3602917	冷陰極電離真空計
2004年10月1日	特3602861	金属ケイ化物膜の形成方法
2004年9月24日	特3599950	金属ペーストの焼成方法
2004年9月24日	特3599782	磁気浮上搬送装置に於けるワーク検出方法と装置
2004年9月17日	特3597217	誘電体膜の成膜方法
2004年9月10日	特3594692	有機焦電圧電体の形成方法
2004年8月13日	特3585633	蒸着重合装置
2004年8月13日	特3585519	スパッタ装置及びスパッタ方法
2004年8月13日	特3585504	多層膜コンデンサーの製造方法
2004年8月6日	特3583294	プラズマ放出装置及びプラズマ処理装置
2004年8月6日	特3583174	直流電源回路装置
2004年7月30日	特3580967	真空計
2004年7月30日	特3580916	基板加熱装置
2004年7月9日	特3574279	超高真空用真空計
2004年7月9日	特3573218	薄膜製造方法
2004年6月25日	特3568667	漏洩検査装置
2004年6月18日	特3565948	プラズマCVD装置
2004年6月11日	特3563152	真空ポンプ
2004年5月28日	特3558655	マグネトロンスパッタ装置
2004年4月30日	特3550457	浮遊電位基板入射イオンのエネルギー及び質量の分析法及び装置
2004年4月23日	特3548584	電極箔の製造法
2004年4月23日	特3548583	電極箔
2004年4月23日	特3548582	電極箔
2004年4月23日	特3547027	銅配線製造方法

2004年4月16日	特3545050	スパッタリング装置、及びスパッタリング薄膜生産方法
2004年4月2日	特3540068	粉粒体用イオン照射装置
2004年4月2日	特3540064	ドライ真空ポンプ前段用のトラップ
2004年3月19日	特3534989	成膜装置用構成部品
2004年2月27日	特3526980	真空・ガス雰囲気熱処理炉
2004年2月20日	特3524243	連続式真空熱処理炉
2004年2月20日	特3524242	連続式真空焼結炉
2004年1月30日	特3516821	ラジカルを用いた有機薄膜形成方法、及び有機薄膜形成装置
2004年1月30日	特3516819	モノマーの蒸発システム、同蒸発システムを備えた真空処理室、および有機化合物膜の成膜方法
2004年1月30日	特3516804	イオン浸炭炉、及び搬送治具
2004年1月23日	特3514488	マグネトロンスパッタ方法及び装置
2004年1月9日	特3510951	プラズマ発生装置
2004年1月9日	特3510434	プラズマ処理装置、クリーニング方法
2004年1月9日	特3510041	エッチング装置